

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ "НАНО- И МИКРОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА" В 2017 г.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Лучинин В. В. Российский пилотный проект инженерингового центра "Гибкая печатная электроника и фотоника" № 8

НАНОТЕХНОЛОГИИ И ЗОНДОВАЯ МИКРОСКОПИЯ

Булярский С. В., Дудин А. А., Орлов А. П., Павлов А. А., Шаманаев А. А., Леонтьев В. Л. Резонанс углеродной нанотрубки с током в электромагнитном поле № 7

Глухова О. Е., Савостьянов Г. В. Транспортные свойства оксидированных графеновых нанолент с зигзагообразным краем: влияние эпоксидных групп № 7

Кулиш О. А., Векшин М. М. Интегрально-оптический преобразователь поляризации излучения на основе асимметричного волновода в стекле № 11

Ларионов Ю. В. Сканирование поверхности кремния в высоковольтном РЭМ без контаминации . . . № 6

МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ МНСТ

Абрамов И. И., Коломеецева Н. В., Лабунов В. А., Романова И. А. Моделирование полевых графеновых транзисторов с одним и двумя затворами . . . № 12

Алферов Ж. И., Зубов Ф. И., Цырлин Г. Э., Жуков А. Е., Шаврук Н. В., Павлов А. Ю., Пономарев Д. С., Ключков А. Н., Хабибуллин Р. А., Мальцев П. П. Создание первого отечественного квантово-каскадного лазера терагерцового диапазона частот № 5

Бороденков Н. И., Бохов О. С., Смирнов А. В., Шилков В. М. Разработка программных средств для проектирования и создания устройств гибкой печатной электроники № 8

Дашков А. В., Шаврук Н. В., Щеглова Т. А., Тарасов Н. С., Мальцев П. П., Хабибуллин Р. А. Апробация способа изготовления контейнеров из антистатического материала для полупроводниковых кристаллов сложной формы на основе 3D-печати № 9

Деспотули А. Л., Андреева А. В. Размерные факторы и нелинейные процессы в структурно-динамическом подходе наноионики № 6

Исмагилов Ф. Р., Вавилов В. Е., Бекузин В. И., Айгузина В. В. Проектирование сверхвысокоскоростных электрических микромашин с частотой вращения 1,2 млн оборотов в минуту № 10

Колчужин В. А., Князев И. В., Палагин М. С., Глухов А. В. Макромоделирование торсионного микроэлектромеханического резонатора № 2

Ларионов Ю. В., Озерин Ю. В. Вариация значений ширины выступов при измерении их в низковольтном РЭМ № 12

Лобанов С. В., Федоров И. А., Шешин Е. П., Григорьева И. Г., Антонов А. А. Разработка автоэмиссионных установках с планарными цилиндрическими магнет-

катодов методом прессования пирографита с тройным карбонатом № 1

Путинцев Б. Г. Разработка однокристалльных приемопередающих модулей V-диапазона на нитриде галлия № 12

Рубцов Ю. В., Алексеева А. В. Разработка IBIS-модели микросхем концентраторов сетей, применяемых для проектирования телекоммуникационной аппаратуры № 6

Рыжий В. И., Рыжий М. В., Отсуджи Т. На пути к реализации терагерцовых лазеров на основе графеновых гетероструктур № 5

Старых А. А., Ковалев А. В. Конвейерное суммирование с использованием самосинхронных схем № 3

Тимошенко С. П., Шалимов А. С., Головинский М. С., Калугин В. В., Коробова Н. Е., Тимошенко А. С., Анчутин С. А. Маршрут проектирования МЭМС-акселерометра, оптимизированного по выбранным параметрам для обеспечения возможности самокалибровки № 12

МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МНСТ

Алешин А. Н. Изучение деформационного поля в слоях метаморфного ступенчатого буфера на основе тройных растворов $\text{In}_x\text{Al}_{1-x}\text{As}$ методом построения карт обратного пространства № 9

Афанасьев П. В., Бохов О. С., Мандрик И. В., Старцев В. А. Каплеструйная технология гибкой печатной электроники для изготовления пассивных элементов № 8

Боброва Ю. С., Андроник М. Методы нанесения толстых слоев жидких фотополимеров высокой вязкости № 4

Бохов О. С., Афанасьев П. В. Электрогидродинамический способ печати наноразмерных 2D- и 3D-структур № 8

Бугаев А. С., Глинский И. А., Пушкарев С. С., Лаврухин Д. В., Ячменев А. Э., Хабибуллин Р. А., Пономарев Д. С. Разработка материалов и фотопроводящих антенн на их основе для генерации и детектирования импульсного и непрерывного терагерцового (ТГц) излучения № 5

Булатов М. Ф., Кутвицкий В. А., Миронова Е. В., Останина О. И., Плотникова А. А. Использование гексацаноферратов для создания полимерных рецепторных слоев сенсорных гетероструктур № 10

Буряков А. М., Билык В. Р., Мишина Е. Д., Галиев Г. Б., Климов Е. А., Мальцев П. П., Пушкарев С. С. Генерация терагерцового излучения низкотемпературными мультислойными эпитаксиальными пленками $i\text{-LT-GaAs}/n\text{-GaAs}$ на подложках GaAs с ориентациями (100) и (111)A № 2

Васильев Д. Д., Моисеев К. М. Расчет движения подложки для повышения равномерности покрытий в ронах № 10

Войцеховский А. В., Кульчицкий Н. А., Несмелов С. Н., Дзядух С. М. Влияние приповерхностных варизонных слоев на адмиттанс МДП-структур на основе МЛЭ $n(p)\text{-Hg}_1 - x\text{Cd}_x\text{Te}$ ($x = 0,21 \dots 0,23$) в диапазоне температур (9...77) К. № 1

Воловликова О. В., Гаврилов С. А., Сыса А. В., Савицкий А. И., Дронова Д. А., Железнякова А. В., Павлов А. А. Сравнительный анализ процессов металл-стимулированного химического травления кремния с использованием тонких пленок Ag и Ni для формирования 3D-структур Si. № 11

Галиев Г. Б., Бураков А. М., Билык В. Р., Хусяинов Д. И., Мишина Е. Д., Климов Е. А., Клочков А. Н., Пушкарев С. С., Васильевский И. С., Грехов М. М., Трунькин И. Н., Васильев А. Л. Терагерцевое излучение эпитаксиальных низкотемпературных GaAs структур на подложках GaAs (100) и (111)A. № 9

Гусев Е. Э., Делкова А. А., Дюжев Н. А., Ковалев А. С., Онуфриенко А. П. Исследование влияния операционных параметров процесса PECVD на характеристики пленок диоксида кремния. № 6

Данилаев М. П., Дорогов Н. В., Куклин В. А., Курангышев А. В. Измерение характерного размера субмикронных частиц в технологических процессах методом светового рассеяния. № 7

Дюжев Н. А., Махиборода М. А., Гусев Е. Э., Катеев М. В. Формирование планарной поверхности пластин для проведения технологических операций контактной литографии и бондинга. № 1

Желаннов А. В., Ионов А. С., Петров А. В., Селезнев Б. И. Использование технологии микропрофилирования при формировании приборных структур на основе нитрида галлия. № 7

Заблочкая Е. Ю., Род И. А., Таренкин А. И., Казачков А. О., Шамирян Д. Г. Автоматизированная инспекция дефектов литографии как метод контроля качества МЭМС-элементов. № 10

Зайцев Н. А., Красников Г. Я. Влияние особенностей химической связи Si—O на структурно-примесные свойства диоксида кремния. № 11

Камалджит Сингх. Выбор материала подложки в технологиях производства МЭМС для СВЧ-приложений. № 7

Климов Е. А., Лаврухин Д. В., Пушкарев С. С., Рубан О. А., Алешин А. Н. Неразрушающие методы контроля арсенидных и нитридных гетероструктур с квантовой ямой. № 5

Ковалевский А. А., Комар О. М. Исследование самоорганизации нанокластеров тетраоксисилицида титана при разложении воды на полупроводниковом дисилициде титана. № 1

Ковалевский А. А., Строгова А. С., Комар О. М. Исследование влияния чистоты поверхности подложек на процесс образования и трансформацию нанокластеров кремний-германий. № 3

Ковалевский А. А., Строгова А. С., Шевченко А. А., Котов Д. А., Гранько С. В. Получение методом механохимии ультрадисперсных порошков кремния и исследование их физико-химических свойств. № 11

Конаков С. А., Дзюбаненко С. В. Влияние явления проскальзывания скорости на режимы работы и другие

характеристики газового химического микрореактора. № 10

Кульчицкий Н. А., Маянов Е. П., Наумов А. В. Арсенид галлия и приборы нано-, микро- и оптоэлектроники на его основе. № 4

Мустафаев Г. А., Мустафаева Д. Г., Мустафаев М. Г. Получение однородных по структуре и равномерных по толщине диэлектрических покрытий при формировании приборных структур. № 3

Мустафаев Г. А., Мустафаева Д. Г., Мустафаев М. Г. Влияние ионизирующих излучений на электрофизические свойства халькогенидов элементов первой группы. № 4

Мустафаев Г. А., Мустафаева Д. Г., Мустафаев М. Г. Формирование структур пленочных преобразователей с заданными параметрами. № 1

Непочатенко В. А., Непочатенко И. А. Определение температурной зависимости параметров кристаллической решетки в сегнетоэлектриках при фазовом переходе $m3mF4mm$ № 3

Павлов А. Ю. Переход от сплавной к несплавной технологии омических контактов при росте диапазона рабочих частот СВЧ МИС на основе нитрида галлия. № 9

Путинцев Б. Г. Разработка однокристалльных приемопередающих модулей V-диапазона на нитриде галлия. № 12

Ревин М. В., Коблов Э. А., Смотрин Д. С., Иванов В. А., Котков А. П., Данильцев В. М., Хрыкин О. И., Дроздов М. Н., Юнин П. А., Молдавская Л. Д., Шашкин В. И. Транзисторные псевдоморфные гетероструктуры на основе (Al-In-Ga)As, выращенные методом металлоорганической газофазной эпитаксии. № 11

Симаков В. В., Синев И. В., Смирнов А. В., Осыко И. Д., Гребенников А. И., Сергеев С. А. Влияние освещения на газочувствительность тонких пленок диоксида олова к парам этанола при комнатной температуре. № 1

Смолин В. К. Формирование 3D-элементов в кремниевых структурах. № 7

Стецюра С. В., Буланов М. С., Козловский А. В., Мальяр И. В. Электростатический потенциал как фактор контролируемого синтеза гибридных структур. № 2

Топталов С. И., Устинов Е. М., Афанасьев П. В., Бохов О. С., Мандрик И. В., Старцев В. А. Создание антенных печатных модулей каплеструйной технологией. № 8

Трофимов А. А. Оптимизация толщины подложки приборных пластин сапфира и карбида кремния. № 4

Федоров Ю. В., Бугаев А. С., Павлов А. Ю., Гнатюк Д. Л., Матвеев О. С., Павлов В. Ю., Слаповский Д. Н., Томош К. Н., Енюшкина Е. Н., Галиев Р. Р., Майтама М. В., Зуев А. В., Крапунин Д. В., Гамкредзе С. А. Технология изготовления и разработка монолитных интегральных схем на основе нитрида галлия. № 5

Щаврук Н. В., Редькин С. В., Трофимов А. А., Иванова Н. Е., Скрипниченко А. С., Кондратенко В. С., Стыран В. В. Разделение полупроводниковых пластин из твердого материала на кристаллы. № 5

Юхневич А. В., Майер И. А., Усенко А. Е. К технологии изготовления НЭМС-устройств № 3

ЭЛЕМЕНТЫ МНСТ

Адамов Ю. Ф., Балака Е. С., Исаева Т. Ю., Матвеев О. С. Распределенная система защиты КМОП-микросхем от электростатических разрядов . . . № 1

Афонин С. М. Структурно-параметрические модели электромагнитоупругих актюаторов для нано- и микросистемной техники № 4

Баранов А. А., Жукова С. А., Обижаев Д. Ю., Турков В. Е., Заруцкий А. А., Гудошников С. А. Магнитоимпедансный чувствительный элемент на основе аморфного ферромагнитного микропровода и тонкопленочной катушки № 10

Бардин В. А., Васильев В. А., Громков Н. В., Жоао А. Ж. Универсальный модуль ЧИРП и его интеграция с нано- и микроэлектромеханическими системами датчиков и актюаторов № 2

Басов М. В., Пригодский Д. М. Исследование чувствительного элемента датчика давления на основе биполярного тензотранзистора № 11

Белкин М. Е., Ключник Д. А., Фофанов Д. А. Характеристики электрооптического преобразования современных лазерных излучателей при распределении по оптическому волокну опорных радиосигналов дециметрового диапазона № 9

Гасников А. О., Ершов М. И., Трушлякова В. В., Макаревская Е. А. Взаимодействие электронного пучка с ячейкой памяти кристалла ИМС № 12

Гурин Н. Т., Родионов В. А., Ишелев А. И. Линейный полупроводниковый координатно-чувствительный фотоприемник с переменным напряжением питания № 2

Дорофеев Р. Ю., Козлов Д. В., Смирнов И. П., Жуков А. А. Влияние технологических погрешностей изготовления микросистемного вибрационного модулятора электрических полей на его характеристики . . . № 1

Драгунов В. П., Киселев Д. Е., Синицкий Р. Е. Особенности электромеханических взаимодействий в МЭМС с непараллельными электродами № 6

Жукова С. А., Турков В. Е., Демин С. А., Четверов Ю. С., Солодков А. А. Чувствительные элементы инфракрасных систем технического зрения на основе микроболометрических матриц формата 640 × 480 пикселей № 2

Иванов Е. А. Методика уменьшения значения коммутируемого напряжения в силовых ключах обратноходовых источников питания № 11

Камалджит Сингх, Мина Р. К., Нирмал А. В. Реализация плоского нагревателя на кремниевых и стеклянных подложках с использованием технологии КМОП № 11

Караян Г. С., Гандилян С. В., Гандилян В. В. Современное состояние и перспективы развития микросистемной электромеханики № 6

Козлов Д. В., Смирнов И. П., Жуков А. А., Болотник Н. Н. Микромеханические компоненты микроробототехнических устройств космического назначения № 3

Лукичев В. Ф., Лебедев К. В., Кальнов В. А. Моделирование характеристик низковольтного МЭМС-переключателя латерального типа с пружиной типа "Менандр" № 7

Лучинин В. В., Ильин С. Ю. Механоактивируемые ультрагибкие конформные интегрируемые рекуператоры энергии № 8

Масальский Н. В. Широкополосный фотонный фазовый модулятор на структуре "кремний на изоляторе" № 12

Мастеров В. В., Рогаткин Ю. Б. Цифровая ФАПЧ для технологического процесса с нормами 65 нм . . № 7

Матвеев О. С. Интегрированные антенны для использования в системах на кристалле № 9

Морозов А. И. Магниторезистивная память с записью электрическим полем на основе упругого взаимодействия слоев № 12

Мухуров Н. И., Гасенкова И. В., Андрухович И. М., Застенкер Г. Н., Бородкова Н. Л., Каримов Б. Т. Датчики потоков космической плазмы с прецизионными селектирующими элементами № 12

Садков В. Д., Фомина К. С. Поглощающие элементы для реализации широкого диапазона ослаблений . . . № 4

Садков В. Д., Фомина К. С. Расчет сопротивления пленочного элемента произвольной формы № 6

Смолин В. К. Модификация свойств резистивных элементов термической обработкой № 3

Тимошенков В. П., Хлыбов А. И., Родионов Д. В. Исследование параметров НЕМТ-транзистора в гигагерцовом диапазоне № 10

Федулов Ф. А., Фетисов Л. Ю., Чашин Д. В. Автономный маломощный источник энергии на основе широкополосного пьезоэлектрического преобразователя № 2

Фетисов Л. Ю., Серов В. Н., Быковцев Ю. А., Маковкин С. А., Фетисов Ю. К., Казакевич И. С. Пороговый датчик магнитных полей на основе автогенератора с магнитоэлектрическим резонатором . . . № 3

БИОЭЛЕКТРОНИКА

Ильин С. Ю., Лучинин М. В. Интеллектуальная искусственная кожа — эпидермальный мониторинг и коррекция биообъектов № 8

ПРИМЕНЕНИЕ НМСТ

Смолин В. К. Использование микро- и нанотехнологий в производстве малогабаритных первичных источников электропитания № 4